



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 38446—2020

---

## 微机电系统(MEMS)技术 带状薄膜抗拉性能的试验方法

Micro-electromechanical system technology—  
Test methods for tensile property measurement of strip thin films

2020-03-06 发布

2020-10-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 试验方法 .....	2
5 数据处理 .....	4
附录 A (资料性附录) 采用 MEMS 工艺的样品制备 .....	5
附录 B (资料性附录) 对准偏差和几何结构对性能测试的影响 .....	7
附录 C (资料性附录) 纳米压痕仪的测试结果误差及补偿 .....	9
参考文献 .....	10

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国微机电技术标准化技术委员会(SAC/TC 336)提出并归口。

本标准起草单位:北京大学、中机生产力促进中心、北京智芯传感科技有限公司、无锡华润上华科技有限公司、中北大学、北京必创科技股份有限公司。

本标准主要起草人:张威、李海斌、张亚婷、朱悦、夏长奉、石云波、陈得民、马书娜、程红兵、周浩楠。